

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
【部門区分】第6部門第1区分  
【発行日】平成17年2月3日(2005.2.3)

【公開番号】特開2003-279318(P2003-279318A)  
【公開日】平成15年10月2日(2003.10.2)  
【出願番号】特願2002-376020(P2002-376020)  
【国際特許分類第7版】

G 0 1 B 11/02

【F I】

G 0 1 B 11/02 H

【手続補正書】  
【提出日】平成16年2月27日(2004.2.27)  
【手続補正1】  
【補正対象書類名】明細書  
【補正対象項目名】特許請求の範囲  
【補正方法】変更  
【補正の内容】  
【特許請求の範囲】  
【請求項1】

被測定物が形成された測定基板を支持する機構部と、上記被測定物を照明する照明手段と、上記測定基板を光学顕微鏡を介して撮像する撮像装置と、上記撮像装置からの映像信号を処理し、上記被測定物の寸法を計測する信号処理部とからなる線幅測定装置において、上記撮像装置を上記測定基板の上記被測定物が形成された側とは、反対側に配置し、上記被測定物を上記照明手段により上記測定基板側から照明し、その反射光を上記測定基板を介して上記撮像装置で撮像することを特徴とする線幅測定方法。

【請求項2】

被測定物が形成された測定基板を支持する機構部と、上記被測定物を照明する照明手段と、上記測定基板を光学顕微鏡を介して撮像する撮像装置と、上記撮像装置からの映像信号を処理し、上記被測定物の寸法を計測する信号処理部とからなる線幅測定装置において、上記撮像装置および上記照明手段を上記測定基板の上記被測定物が形成された側とは、反対側に配置し、上記被測定物を上記測定基板を介して上記撮像装置で撮像することを特徴とする線幅測定装置。

【請求項3】

請求項2記載の線幅測定装置において、更に上記測定基板を支持する機構部または上記撮像装置のいずれかを駆動する機構部を有することを特徴とする線幅測定装置。

【請求項4】

請求項2記載の線幅測定装置において、上記測定基板を支持する機構部を上記測定基板がほぼ縦方向になるように構成したことを特徴とする線幅測定装置。

【請求項5】

請求項2記載の線幅測定装置において、上記被測定物が形成された測定基板は、カラーフィルタを形成された液晶基板およびTFT基板のいずれかであることを特徴とする線幅測定装置。光学顕微鏡と撮像装置とによって透明基板上の被測定物の微小寸法を測定する線幅測定装置において、上記被測定物を上記透明基板の裏側から測定することを特徴とする線幅測定方法。